

フォトレジスト、有機溶剤およびプロセスガスのろ過

“エンフロン”は、PTFEメンブレン (0.05、0.1、0.2、0.45、1.0 μm のろ過精度) とポリプロピレン製部品で構成されています。これらの材質により、幅広い耐薬品性があり、フォトレジストを始めとするリソグラフィプロセスで使用される有機溶剤、さらには洗浄プロセスで使用されるIPAをはじめとする洗浄液の精密ろ過に適しています。また、流量特性が優れているために、コンパクトサイズで、窒素ガス、乾燥エアのろ過が可能です (FRグレード)。*1*2

特長

- 低い圧力損失
- 全品フラッシング済
- 0.05 μm から 1.0 μm までの5種類のろ過精度
- ガスでのろ過精度は 3nm (0.003 μm) (FRグレード)

利点

- コンパクトサイズで優れた除去効果
- 端切り量の低減が可能
- より高純度なるろ過が可能
- プレフィルターからファイナルフィルターまでのシステム設計が容易

材質

構成部品	材質
フィルターメディア	PTFE
メディアサポート	ポリプロピレン
サポートコア	ポリプロピレン
アウターケース	ポリプロピレン
エンドキャップ	ポリプロピレン

仕様

カートリッジ種類*3		AB1	MCY1001	MCY4463	MDY2230
ろ過表面積		0.88 m ²	0.86 m ²	0.31 m ²	0.15 m ²
最高使用温度		90 °C			
耐差圧	50 °C	0.55 MPa			
	51 °C~90 °C	0.34 MPa			
ろ過制度	グレード				
0.05 μm	FDE	○	—	○	○
0.1 μm	FTE	○	○	○	○
0.2 μm	FRE	○	○	○	○
0.45 μm	FXE	○	○	○	○
1.0 μm	FNE	○	○	○	○

*1 フィルター選定時に必ず流体適合をご確認ください。

*2 長期使用により部品は劣化します。定期的な交換をおすすめします。

*3 オールディスポーザブルタイプのDFAフィルターに関しては、カタログNo.PFLT006をご参照ください。



流体適合性

“エンフロン”は、幅広い耐薬品性を有していますが、90°C以上の流体のろ過や高濃度硫酸/過水のろ過には、オールフッ素樹脂製“エンフロンPF”をお奨めします。また、流体適合性はそれぞれの使用条件により異なるため、事前に使用条件をご確認ください。

O-リングタイプ 製品型式

AB ① ② ③ E ④

①	コード	カートリッジ長さ (インチ)
	1	10
	2	20
	3	30

②	コード	ろ過精度 (μm)
	FD	0.05
	FT	0.1
	FR	0.2
	FX	0.45
	FN	1.0

③	コード	O-リング規格
	7	AS568A-226
	8	AS568A-222
	3	AS568A-222

④	コード	O-リング材質
	H4	シリコン
	HF	耐酸用フッ素ゴム
	J	EPDM
	H1	FEPカプセルフッ素ゴム
	H38	FFKM

内部O-リングタイプ 製品型式

MCY4463 ⑤ E ⑥

MDY2230 ⑤ E ⑥

⑤	コード	ろ過精度 (μm)
	FD	0.05
	FT	0.1
	FR	0.2
	FN	1.0

⑥	コード	O-リング材質
	H4	シリコン
	HF	耐酸用フッ素ゴム
	J	EPDM
	H38	FFKM

ガスケットタイプ 製品型式

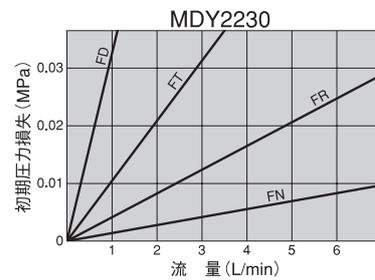
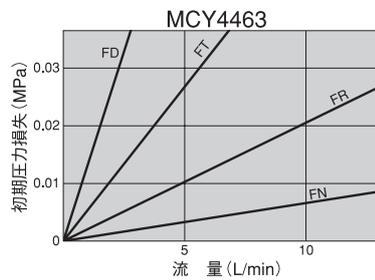
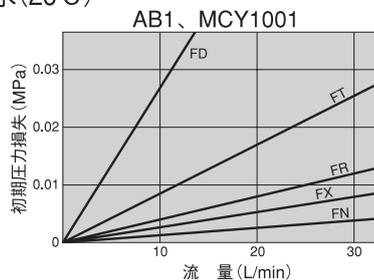
MCY1001 ⑦ E ⑧

⑦	コード	ろ過精度 (μm)
	FR	0.2
	FX	0.45
	FN	1.0

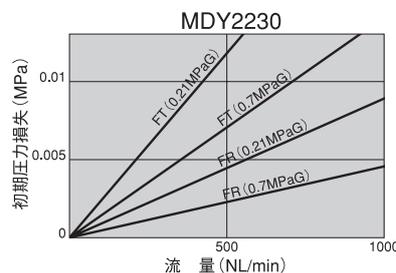
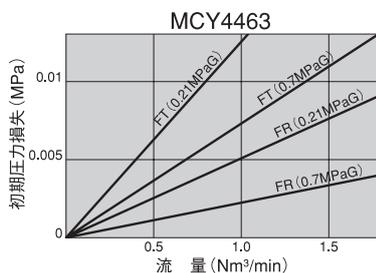
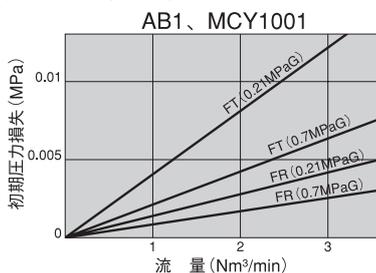
⑧	コード	ガスケット材質
	H13	NBR
	H	フッ素ゴム
	J	EPDM

流量－圧力損失特性

水(20℃)



乾燥エア(21℃)



〒163-1325 東京都新宿区西新宿 6-5-1

マイクロエレクトロニクス事業部 TEL.03(6901)5700

本カタログに記載されているデータは特定条件下で得られた代表値です。本カタログに記載された情報により得られる結果並びに本製品の安全性については保証するものではありません。本製品をご使用になる前に、本製品が使用目的に対して適正かつ安全であることをご確認ください。なお、本カタログに記載されている内容は予告無しに変更される場合がございます。

05/2024 改訂